DEC 1 9 2001

PATENT 0941-0308P

IN THE U.S PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant:

Chih-Ping TAN

Conf.:

Appl. No.:

09/930,204

Group:

UNASSIGNED

Filed:

August 16, 2001

Examiner: UNASSIGNED

For:

METHOD FOR PROTECTING MOS COMPONENTS FROM ANTENNA EFFECT AND THE APPARATUS

THEREOF

LETTER

Assistant Commissioner for Patents Washington, DC 20231

December 19, 2001

Sir:

Under the provisions of 35 U.S.C. § 119 and 37 C.F.R. § 1.55(a), the applicant(s) hereby claim(s) the right of priority based on the following application(s):

Country

Application No.

Filed

TAIWAN, R.O.C.

090105923

March 14, 2001

#32,334

A certified copy of the above-noted application(s) is(are) attached hereto.

If necessary, the Commissioner is hereby authorized in this, concurrent, and future replies, to charge payment or credit any overpayment to Deposit Account No. 02-2448 for any additional fee required under 37 C.F.R. §§ 1.16 or 1.17; particularly, extension of time fees.

Respectfully submitted,

BIRCH, STEWART, KOLASCH & BIRCH, LLP

TC 17001 PD

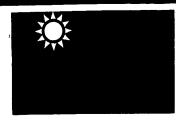
P.O. Box 747

Falls Church, VA 22040-0747

(703) 205-8000

KM/asc 0941-0308P

Attachment



Aug 16 200 |
Altorney Doubat No
Birch Stanor+ Korasch

0 正 宋華民國經濟部智慧財產局

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS
REPUBLIC OF CHINA

(703) WS-8000

REPUBLIC OF C

茲證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛,其申請資料如下:

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunder:

申 請 日: 西元 2001 年 03 月 14 E

Application Date

기도 인도 있다.

申 請 案 號: 090105923

Application No.

申 請 人: 台灣積體電路製造股份有限公司

Applicant(s)

PECEIVED TO 1700

局 長 Director General

陳明邦

發文日期: 西元 2001 年 10 月16 F

Issue Date

發文字號:

09011015291

Serial No.

BECEINED

TC 2800 MAIL ROOM

JAN 15 2002

जिल्ले जिल्ल

申請日期:	案號:	
類別:	•	

(以上各欄由本局填註)

發明專利說明書		
	中文	避免MOS元件遭受天線效應破壞之方法及其裝置
發明名稱	英 文	
	姓 名 (中文)	1. 譚治平
二 發明人	姓 名 (英文)	1. Chih-Ping Tan
	國籍	1. 中華民國 1. 台北市永吉路278巷48弄16號4樓
	住、居所	
三、請人	姓 名 (名稱) (中文)	1. 台灣積體電路製造股份有限公司
	姓 名 (名稱) (英文)	1.
	國籍	1. 中華民國
	住、居所 (事務所)	1. 新竹科學工業園區園區三路121號
	代表人 姓 名 (中文)	1. 張忠謀
	代表人姓 名(英文)	1.



四、中文發明摘要 (發明之名稱:避免MOS元件遭受天線效應破壞之方法及其裝置)

一種避免MOS元件遭受天線效應破壞之方法及其裝置,透過旁路PMOS電晶體與旁路NMOS電晶體之設置,能夠將因天線效應所累積之不同極性電荷,有效地予以放電排除,以避免積體電路內MOS元件之薄閘極氧化層遭受破壞、或改變MOS元件之特性。

英文發明摘要 (發明之名稱:)



本案已向

國(地區)申請專利 申請日期 案號

主張優先權

無

有關微生物已寄存於

寄存日期 寄存號碼

無

# 五、發明說明 (1)

本發明係有關於一種MOS元件之保護方法及其裝置,特別是有關於一種避免MOS元件遭受天線效應破壞之方法及其裝置。

在電漿蝕刻中,電漿所導致之元件損壞,稱為電漿電符累積損壞(Plasma Charging Damages),或稱之天線效應(Antenna Effect)。電漿中由於局部電荷不均勻,造成電荷累積在面積很大或邊長很長的導體上(如多晶矽、鋁合金),這些電荷將在很薄的閘極氧化層上產生電場。當電荷收集夠多,跨在閘極氧化層上的電場將導致MOS元件特性改變,甚至發生電流貫穿閘極氧化層造成損壞。

第1圖顯示使用二極體來降低天線效應之電路配置。 第1圖中,T1表示在一積體電路中之MOS元件,其基體極 (bulk) B係耦接至其源極、或是最正電壓節點 $V_{DD}$ (或是最 負電壓節點 $V_{SS}$ )。設置於積體電路中之二極體D1,其陽極 係耦接至積體電路之基底(substrate)上。假設,在連接 至MOS元件T1 閘極的導線L1,係具有很大面積或邊長很 長,由於電漿之緣故,上述導線L1 上可能累積有大量之電 荷,而造成天線效應(圖示為Antenna)。

若累積之電荷為負電荷,則二極體D1可提供一放電路徑,藉以將負電荷排放至積體電路之基底,以避免MOS元件T1之閘極氧化層遭到損壞。但是,當累積之電荷為正電荷,由於缺乏放電路徑,故跨在MOS元件T1閘極氧化層上的電場將導致閘極氧化層之損壞。此外,由於二極體D1具有較大之雜散電容,對於積體電路本身之運作速度亦會造





### 五、發明說明 (2)

成不良之影響。

第2圖顯示使用傳輸閘(transmission gate)來降低天線效應之電路配置。第2圖中,連接至MOS元件T2閘極的導線L2,係具有很大面積或邊長很長,由於電漿之緣故,上述導線L2上可能累積有大量之電荷,而造成天線效應(亦圖示為Antenna)。在此,T2表示在一積體電路中之MOS元件,其基體B極係耦接至其源極、或是最正電壓節點 $V_{DD}$ (或是最負電壓節點 $V_{SS}$ )。

為了降低天線效應,第2圖在積體電路中設置一傳輸開,耦接至上述MOS元件T2之間極。傳輸閘中之NMOS電晶體NT,閘極和基體極係分別耦接節點V<sub>DD</sub>和V<sub>SS</sub>;傳輸閘中之PMOS電晶體PT,閘極和基體極係分別耦接節點V<sub>SS</sub>和V<sub>DD</sub>。無論天線效應累積正電荷、或負電荷,均可透過NMOS電晶體NT(或PMOS電晶體PT)之源/汲極和基底間之寄生二極體,而將正電電荷、或負電荷予以消除,以避免MOS元件T2之間極氧化層遭到損壞。

因為傳輸閘是位在控制MOS元件T2閘極的路徑上,此傳輸閘本身會有寄生之電容C及電阻R,RC會導致控制T2閘極的訊號延遲,降低MOS元件T2之運作速度。為了提升MOS元件T2之運作速度,會希望降低R值,降低R值最快的方法是減少傳輸閘通道長度及增加寬度,但這樣C值亦會同增加。因此,使用傳輸閘來降低天線效應,對於R、C值的取捨會有其困難之處。

有鑑於此,本發明之目的為提出一種避免MOS元件遭





### 五、發明說明(3)

受天線效應破壞之方法及其裝置,主要係透過旁路PMOS電晶體與旁路NMOS電晶體之設置,能夠將因天線效應所累積之不同極性電荷,有效地予以放電排除,以避免積體電路內MOS元件之薄閘極氧化層遭受破壞。

為達成上述目的,本發明提出之避免MOS元件遭受天線效應破壞之方法,包括:①設置一旁路PMOS電晶體於一第一電壓節點和上述MOS元件之閘極間,上述旁路PMOS電晶體之閘極、源極、基體極耦接於上述第一電壓節點,汲極耦接至上述MOS元件之閘極;②設置一旁路NMOS電晶體於一第二電壓節點和上述MOS元件之閘極間,上述旁路NMOS電晶體之閘極、源極、基體極耦接於上述第二電壓節點,汲極耦接至上述MOS元件之閘極。

當天線效應累積之正電荷出現於上述MOS元件之閘極上時,上述旁路PMOS電晶體將正電荷導入上述第一電壓節點,以避免正電荷進入及破壞上述MOS元件。又,當天線效應累積之負電荷出現於上述MOS元件之閘極上時,上述旁路NMOS電晶體將負電荷導入上述第二電壓節點,以避免負電荷進入及破壞上述MOS元件。

為達成上述目的,本發明提出之避免MOS元件遭受天線效應破壞之保護裝置,包括:①一旁路PMOS電晶體,其關極、源極、基體極耦接於一第一電壓節點,其汲極耦接至上述MOS元件之閘極;當天線效應累積之正電荷出現於上述MOS電晶體之閘極上時,上述旁路PMOS電晶體將正電荷導入上述第一電壓節點,以避免正電荷進入及破壞上述



### 五、發明說明(4)

MOS元件;以及,②一旁路NMOS電晶體,其閘極、源極、基體極耦接於一第二電壓節點,其汲極耦接至上述MOS元件之閘極;當天線效應累積之負電荷出現於上述MOS元件之閘極上時,上述旁路NMOS電晶體將負電荷導入上述第二電壓節點,以避免負電荷進入及破壞上述MOS元件。

# 圖式之簡單說明:

為讓本發明之上述目的、特徵、和優點能更明顯易懂,下文特舉較佳實施例,並配合所附圖式,做詳細說明如下:

第1圖顯示使用二極體來降低天線效應之電路配置; 第2圖顯示使用傳輸閘來降低天線效應之電路配置; 第3圖顯示依據本發明實施例,用以降低天線效應破壞之電路配置。

符號說明:

D1~二極體;

T1-T3~NMOS 元件;

Antenna~天線效應;

T~ NMOS 電 晶 體;

PT~ PMOS 電 晶 體 ;

L1-L3~ 導線;

BN~ 旁路NMOS 電晶體;

BP~旁路PMOS電晶體。



#### 五、發明說明 (5)

## 實施例:

第3圖顯示依據本發明實施例,用以降低天線效應破壞之電路配置。

参照第3圖,為了避免積體電路中之MOS元件遭受天線效應之破壞,本發明提出之方法,包括:

①設置一旁路PMOS電晶體BP於一第一電壓節點 $(V_{DD})$ 和上述MOS元件T3之閘極間,上述旁路PMOS電晶體BP之閘極、源極、基體極耦接於上述第一電壓節點 $(V_{DD})$ ,汲極透過導線L3而耦接至上述MOS元件之閘極;

②設置一旁路NMOS電晶體BN於一第二電壓節點( $V_{SS}$ )和上述MOS元件T3之閘極間,上述旁路NMOS電晶體BN之閘極、源極、基體極耦接於上述第二電壓節點( $V_{SS}$ ),汲極透過導線L3而耦接至上述MOS元件T3之閘極。

在此實施例中,上述MOS元件T3係為NMOS電晶體,但亦可能是PMOS電晶體。

参照第3圖,依據上述方法配置,即可得到本發明提出之避免MOS元件遭受天線效應破壞之保護裝置,包括:





#### 五、發明說明 (6)

②一旁路NMOS電晶體BN,其閘極、源極、基體極耦接、於 $V_{SS}$ 電壓節點,其汲極耦接至上述MOS 元件T3 之閘極;當天線效應在導線L3上累積之電荷(Antenna)為負極性,出現於上述MOS 元件T3 之閘極上時,上述旁路NMOS 電晶體,透過其內部之雜散二極體結構,將負電荷導入上述 $V_{SS}$  電壓節點,以避免負電荷進入及破壞上述MOS 元件T3 之閘極氧化層。

由上述可知,本發明之優點有:

- (1)將天線效應累積之正電荷,透過上述旁路PMOS電晶體BP,導入上述 $V_{DD}$ 電壓節點;另外,對於天線效應累積之負電荷,則透過上述旁路NMOS電晶體BN,導入上述 $V_{SS}$ 電壓節點。因此,本發明對於不同極性之電荷累積,本發明均能夠予以排除。
- (2)本發明使用之旁路NMOS、PMOS電晶體,其雜散電容僅存於電晶體之汲極和基底間,故相較於第2圖使用之傳輸閘而言,更能有效地減少寄生電容,同時沒有寄生電阻之問題,可有效提昇被保護元件之運作速度。
- (3)本發明增加之旁路NMOS、PMOS電晶體,對於使用MOS製程之積電路而言,更能增進與其他MOS元件之匹配特性。

雖然本發明已以較佳實施例揭露如上,然其並非用以限定本發明,任何熟悉本項技藝者,在不脫離本發明之精神和範圍內,當可做些許之更動和潤飾,因此本發明之保護範圍當視後附之申請專利範圍所界定者為準。





# 六、申請專利範圍

- 1. 一種避免MOS元件遭受天線效應破壞之保護裝置, 包括:
- 一旁路PMOS電晶體,其閘極、源極、基體極耦接於一第一電壓節點,其汲極耦接至上述MOS元件之閘極;當天線效應累積之正電荷出現於上述MOS元件之閘極上時,上述旁路PMOS電晶體將正電荷導入上述第一電壓節點,以避免正電荷進入及破壞上述MOS元件;
- 一旁路NMOS電晶體,其閘極、源極、基體極耦接於一第二電壓節點,其汲極耦接至上述MOS元件之閘極;當天線效應累積之負電荷出現於上述MOS元件之閘極上時,上述旁路NMOS電晶體將負電荷導入上述第二電壓節點,以避免負電荷進入及破壞上述MOS元件。
- 2. 一種避免MOS元件遭受天線效應破壞之方法,包括:

設置一旁路PMOS電晶體於一第一電壓節點和上述MOS 元件之閘極間,上述旁路PMOS電晶體之閘極、源極、基體 極耦接於上述第一電壓節點,汲極耦接至上述MOS元件之 閘極;

設置一旁路NMOS電晶體於一第二電壓節點和上述MOS 元件之閘極間,上述旁路NMOS電晶體之間極、源極、基體 極耦接於上述第二電壓節點,汲極耦接至上述MOS元件之 閘極;

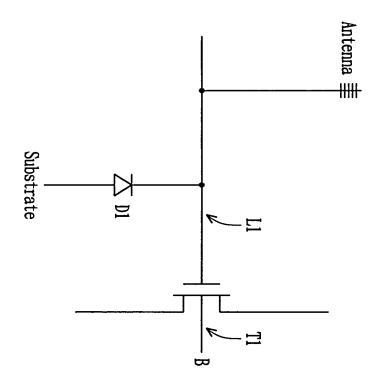
當天線效應累積之正電荷出現於上述MOS元件之閘極上時,上述旁路PMOS電晶體將正電荷導入上述第一電壓節



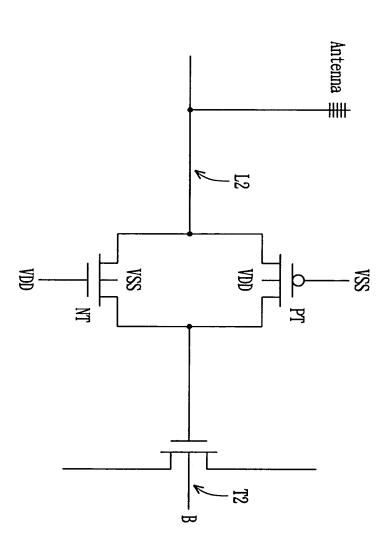
# 六、申請專利範圍

點,以避免正電荷進入及破壞上述MOS元件;當天線效應 累積之負電荷出現於上述MOS元件之閘極上時,上述旁路 NMOS電晶體將負電荷導入上述第二電壓節點,以避免負電 荷進入及破壞上述MOS元件。



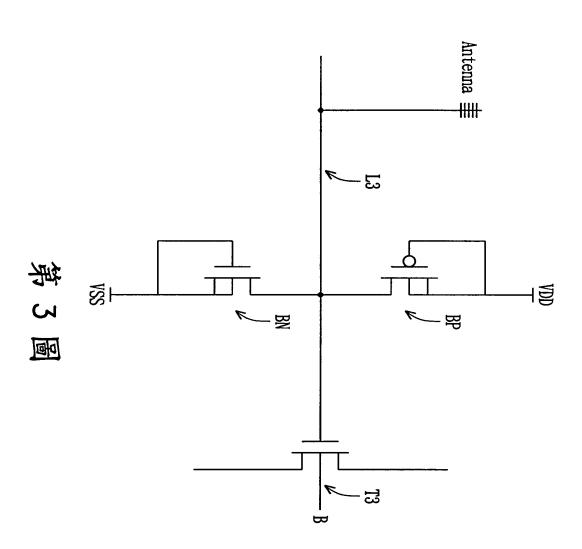


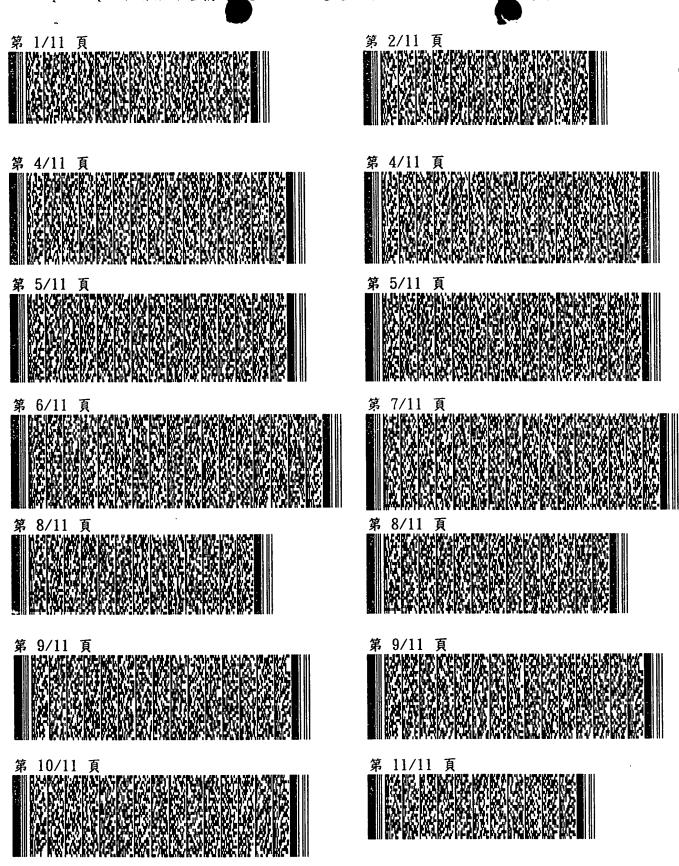
第一圖



第2圖

.





第